



Google Meet

# ATTESTATION DE PARTICIPATION



## 3<sup>ème</sup> SEMINAIRE NATIONAL SUR LA TECHNOLOGIE ET L'INDUSTRIE

Tlemcen le 18 Octobre 2025



Le président du séminaire atteste que :

**Riad Dib MCB**, Département de Technologie, Faculté de Technologie, Université de Bejaia, Bejaia 06000, Algérie

**Khatir Khettab** Professeur, Département de Génie Electrique, , Faculté de Technologie, Université de M'sila, M'sila 28000, Algérie

**Yassine Bensafia** Professeur, Département de Génie Electrique, Facultés des sciences appliquées, Université de Bouira , Bouira 10000, Algérie

**Salim Chelbi MCA**, Département de Génie Electrique, Facultés des sciences appliquées, Université de Bouira, Bouira 10000, Algérie

**Abdenour Mekhmoukh MCA**, Département de Génie Electrique, Faculté de Technologie, Université de Bejaia, Bejaia 06000, Algérie

A(ont) participé au **3<sup>ème</sup> séminaire national sur la technologie et l'industrie** organisé par la Startup Pedagogic and Scientific Conferences and Publications Tlemcen en collaboration avec la Maison des Universitaires pour l'édition, l'imprimerie et la diffusion Tlemcen ainsi que de la Maison Ettachfinya Etilimsania pour l'édition, l'imprimerie et la diffusion Tlemcen qui s'est tenu **le 18 Octobre 2025 à Tlemcen** par une **communication orale** intitulée :

**Une nouvelle approche pour comparer les méthodes d'approximation pour les systèmes d'ordre fractionnaire**



Le président du séminaire



La présidente du comité scientifique



Le président du comité d'organisation